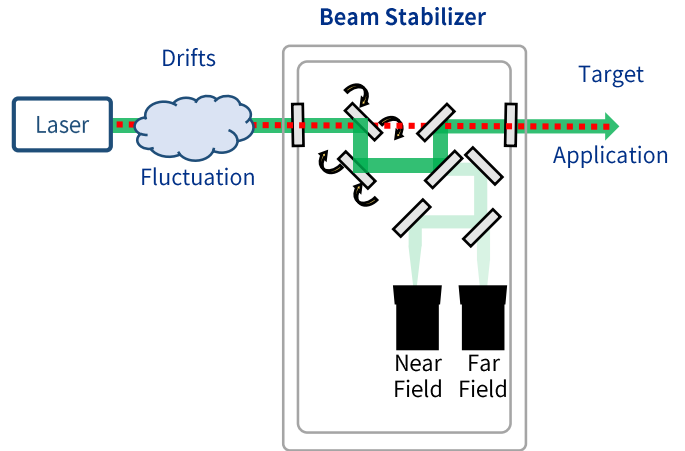
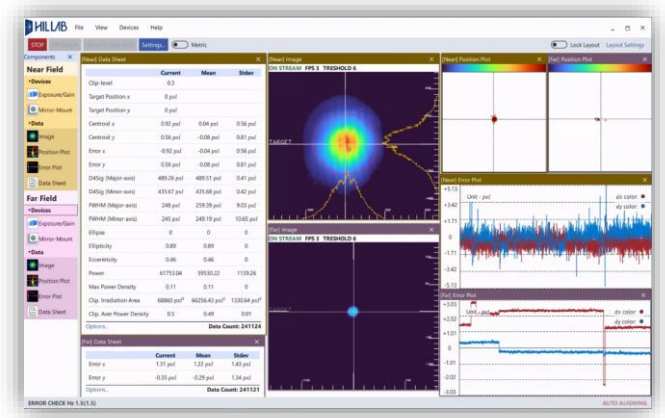


레이저 빔 안정화 시스템

VIS 영역 빔 프로파일 기반 2×2축 미러 제어 안정화 시스템



HIL Lab의 빔 안정화 시스템은 레이저의 위치 및 방향 드리프트를 보상하여 높은 신뢰성과 정밀도를 제공합니다. 두 개의 2축 모터 마운트로 빔 자동 정렬 제어를 수행할 수 있으며, 카메라로 수집한 빔 프로파일의 중심을 트래킹합니다. ISO 11146-2와 ISO 13694에 의거하여 빔 프로파일을 실시간으로 계산 및 표시, 저장합니다. 안정화 중 빔이 꺼지거나 설정값 이하가 되면 미러의 위치를 고정하여 정렬이 변경되지 않으며, 사용자가 원하는 위치로 빔의 정렬 목표를 지정할 수 있습니다.



특징

- Near-field, far-field 빔 프로파일 추적
- 인라인 구성이 용이한 작은 크기
- 레이저 사양 맞춤 미러 제공

사양

파장 범위	320-1100 nm
구성	2×2축 미러 마운트
최대 입사 빔 크기	Φ10 mm
각도 범위	±2°
민감도	1 μrad
빔 프로파일 재생 속도	5 Hz
빔 위치 안정도	< 6 μm
빔 포인팅 안정도	< 24 μrad

활용

- 미세 정렬 유지가 필요한 곳
- 광섬유 결합 유지
- 장거리 빔 전송 후 최종 광학부 입사 전

전력 요구량	0.5 A @USB +5V 6.2 W @PoE
인터페이스	USB & GigE PoE (2ch)
OS	Windows 7, 8, 10
크기	150×250×85 mm ³ (바닥 어댑터 제외)
	200×250×98 mm ³ (바닥 어댑터 포함)